

# 微小残留なし流量バルブ



## コフロック

### シールレスで省スペース

【京都】コフロック（京都府京田辺市、小島望社長）は、半導体洗浄装置をターゲットに業界初のシールレス構造で、パーティクル（微小異物）残留も液漏れもないダイヤフラム式流量制御バルブを開発した。耐薬液性に優れ、屈曲性や強度面で異なるフッ素樹脂をそれぞれに使うダイヤフラム（上部の弁）と本体を溶着・一体化し、すき間をなくした。課題だった数ナギ（ナノは10億分の1）サイズの微小異物の残留がなくなり、装置の生産性向上に貢献する。

### 半導体洗浄装置向け

サンプル受注を近く始める。オーリングや嵌合などを用い、ダイヤフラムと本体で数ナギ（マイクログは100万分の1）数ナギのすき間が生じる一般的な従来品より、価格は若干上がるもよう。2023年夏から量産予定。サンプル受注を近く始めるダイヤフラム式流量制御バルブ

定で年4000台の販売を目指す。すでに装置大手から引き合いがある。

サンプル受注を近く始める。オーリングや嵌合などを用い、ダイヤフラムと本体で数ナギ（マイクログは100万分の1）数ナギのすき間が生じる一般的な従来品より、価格は若干上がるもよう。2023年夏から量産予定。サンプル受注を近く始めるダイヤフラム式流量制御バルブ

で薬液使用量の削減やより高度な洗浄を実現するピエゾアクチュエーター駆動タイプなども追加する方針だ。純水、薬液、腐食性ガスなどに対応。流量範囲は毎分0〜4リットル。従来品比で設置面積が約10%小さいコンパクトさや圧力損失が少ないのも特徴で、半導体洗浄装置の設計自由度の向上にも寄与する。

チャンバー数によるが、同装置1台当たりの流量制御バルブ搭載数は約200〜300台。製薬や化学、研究機関などにも提案する。新製品は弁の駆動がエア式の「KAFV-100」と手動式「KM-FV-100」の2種類。今後、精密制御